

Вакуумная технологическая система КУКУ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Наземное моделирование высоковакуумной, температурной, ультрафиолетовой, атомно-кислородной и озоновой среды ближнего космоса для испытаний материалов, узлов и космических компонентов

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Комплексный вакуумный стенд моделирования факторов ближнего космоса КУКУ
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум	5×10 ⁻⁵ Па
Температура нагрева	от комнатной температуры до 450 К
Температура теплового экрана	≤100 К
Средняя однородность температуры	≤±5 °С
Точность температуры	≤1 К
Коэффициент поверхностного поглощения	>0,9
Плотность потока атомарного кислорода	≥2×10 ¹⁵ АО/см2·с

Назначение

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Что учитывать при подборе

- целевое давление и время цикла
- объём, материал и температура объекта

-
- | | |
|---|--|
| 3 | состав насосов, арматуры и измерительных каналов |
| 4 | автоматизация, безопасность и обслуживание |
-

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru